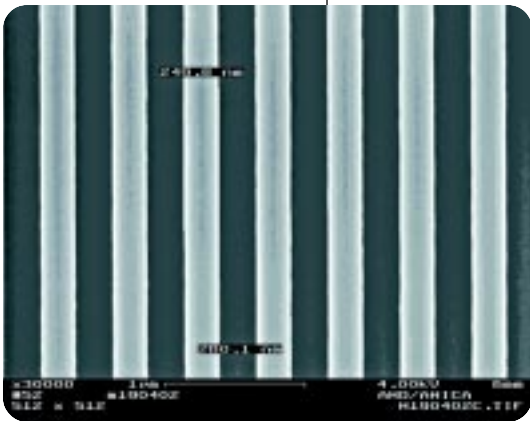
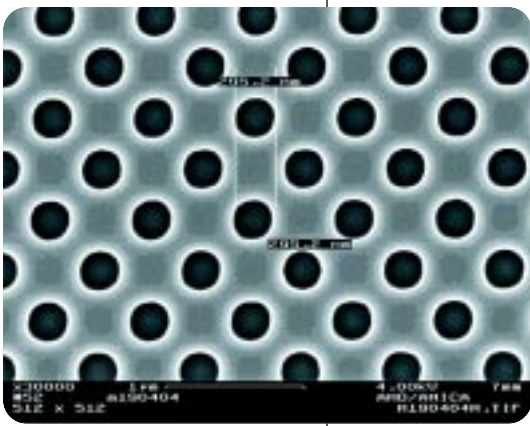
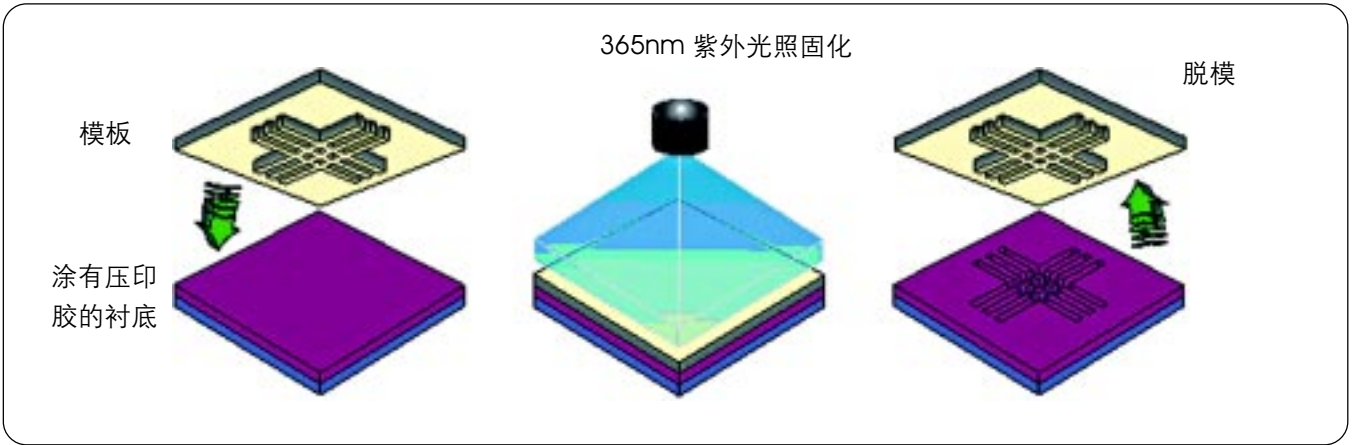


纳米压印技术



纳米压印光刻(NIL)以其分辨率高(纳米量级)、产量高、低成本的特点,正在获得越来越多的关注。NIL的原理比较简单,将刻有目标图形的掩模板压印到相应的衬底上——通常是很薄的一层聚合物膜,实现图形转移后,通过UV光照的方法或热压的方法使转移的图形固化,以完成微纳加工的光刻步骤。

虽然纳米压印的成本相对于其他光刻技术要低,但对于国内的科研单位来说,除了需购置压印设备本身外,如果自行制作模板,则需要建立一个完整的微加工实验室才能完成。

为此,我们推出了模板加工服务。研究人员可以利用我们提供的标准模板和纳米压印胶,方便地熟悉压印工艺技术本身,接下来根据各自的研究课题提出具体要求,由我们来为您制作模板并提供相关技术参数。

